

- **免費課程：ASML 微影技術 training course**
- **時間:108/ 5/15 (三) 17:20-20:00**
- **地點：國立高雄大學圖資館 2 樓宅創空間**
- **經費來源：國立高雄大學深耕計畫/培育半導體光電製程產業跨域人才分項計畫**
- **適合參加對象：理工學院修習過半導體製程技術相關課程高年級、研究所學生、相關領域師長。**
- **聯絡方式：沈亮瑋先生 (tnlfn0147@gmail.com)、鄭秀英教授 (graceho@nuk.edu.tw), 電話： 07-5919459**
- **報名網址：<https://bit.ly/2VwKaP9>**

Time	Speaker	Titile of the presentation
17:20-18:00	ASML Tainan Team	Market Trend of IC Manufacturing - From ASML Perspectives
18:00-18:40		Introduction of ASML Lithography Technology
18:40-19:20		Application Engineers at ASML
19:20-19:40	Break and a light dinner hosted by 國立高雄大學深耕計畫	
19:40-20:00	ASML and Professors	Q&A